

公司申請適用產業創新條例 第10條之2

申請及審查規定

112年10月23日



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

壹、 子辦法規定

公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法 總計23條文

訂定依據、定義、適用對象及資格條件(第1-3條)

前瞻創新研發投資抵減

- 支出適用範圍(第4-6條)
- 地點及成果使用規定(第7條)
- 抵減率及抵減規定(第8條)

先進製程設備投資抵減

- 購置及安裝地點規定(第9條)
- 支出適用範圍、抵減率及抵減規定(第10條)

抵減營所稅範疇、合併抵減上限(第11-12條)

申請規定與應備文件(第13-14條與第17條)

審查機制(第15-16條)

變更適用規定(第19-20條)

其他相關規定(第18條及第21-23條)

一、用詞定義 第2條

居國際供應鏈關鍵地位

- ✓ 指公司生產之產品或提供之服務應用於涉及二個以上國家或地區之產業供應鏈
- ✓ 其產品或服務於該產業供應鏈任一環節具顯著影響力

前瞻創新研究發展

公司投入國際領先技術或成熟製造技術之創新性應用研究發展活動，其適用領域由經濟部公告

先進製程之全新機器或設備

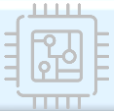
- ✓ 公司投入開發國際領先技術進行商業化量產
- ✓ 或發展已達商業化量產之成熟製造技術之創新性應用，所購置自行使用之全新機器及設備

※每2年邀請相關產業界、學術界、研究機構及政府機關代表檢討適用領域及定義

二、前瞻適用領域 第2條第2項

經濟部於112年8月14日公告下列適用領域

半導體



晶圓製造

積體電路設計

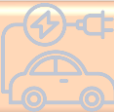
矽基半導體前段製程設備

化合物半導體製程設備

晶圓封裝測試

半導體先進製程關鍵材料及化合物半導體製程用材料

電動車



電動汽車整車

馬達/驅控器

固態電池

自動駕駛輔助系統

車用光達

銅箔

通訊



基地臺射頻與天線

基地臺系統

傳輸設備

低軌道衛星

顯示器



超高解析度面板

先進電子紙

Mini/Micro LED 面板

Micro LED製程設備

新型顯示技術關鍵材料

其他



其他經審查小組同意之領域項目

三、適用對象及資格門檻(1/2) 第3條



依公司法設立之公司

(產業創新條例第2條規定)



最近3年內無違反
環保、勞工或食安衛生相關法律
且情節重大

(由申請公司所屬的中央目的事業主管機關認定)

三、適用對象及資格門檻(2/2) 第3條

共同資格條件

① 於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位

② 研究發展費用

③ 研究發展密度

④ 當年度有效稅率¹未低於

達新臺幣

60 億元

達

6%

112年度

12%

113年度起²

15%

申請先進製程
設備投資抵減

⑤ 購置先進製程設備金額達100億元

註1：指公司當年度依所得稅法規定計算之應納稅額，減除依境外所得已繳納可扣抵之稅額及投資抵減稅額，占其全年所得額之比率

註2：113年度得由本部會同財政部審酌國際間施行OECD最低稅負制情形調整為12%，報請行政院核定並公告之，自114年度起為15%

四、前瞻創新研發適用範疇及抵減規定(1/2) 第4-6條

§4



從事態樣

研究發展單位為限

- ✓ 新產品
- ✓ 新服務
- ✓ 新原料
- ✓ 新材料
- ✓ 零組件

X 改進現有產品或服務

§5



支出範圍

- ✓ 研發人員薪資
- ✓ 消耗性器材、原料、材料及樣品費用
- ✓ 研發用專利權、專用技術、著作權等支出
- ✓ 研發用資料庫、軟體及系統支出
- ✓ 研發人員教育訓練費用
- ✓ 委外及共同研發支出

§6



排除適用

- 屬例行性、測試等支出：
- X 行政管理支出
 - X 例行性支出
 - X 試製原材料
 - X 市場研究及測試
 - X 研發人員差旅費等
 - X 銷售所為之認證測試

四、前瞻創新研發適用範疇及抵減規定(2/2) 第7-8條、 第11-12條

從事研發地點

在我國**境內**從事研究發展 (§7)

除外條款：
依第5條第1項規定有委外研發或共同研發約定由國外公司、大專校院或研究機構執行部分者

使用成果

以**專供公司自行使用**為原則，如供他人製造或使用，應取得合理之權利金或其他合理之報酬 (§7)

抵減方式

- 前瞻創新研發支出金額**25%**，抵減當年度應納營所稅額，抵減上限為**30%**
- 研發支出金額不含政府補助款及研發單位收入，以國稅局核定數為準 (§8)
- 當年度應納營所稅額包含營所稅及未分配盈餘稅 (§11)
- 合併適用2項以上投資抵減，抵減上限為**50%** (§12)

五、先進製程設備適用範疇及抵減規定(1/2) 第9條

購置要件

1. **自行使用**於先進製程之全新機器或設備之支出
2. 取得統一發票或進口報單、**交貨文件**等原始憑證及其相關**付款證明**文件

安裝地點

1. 限於公司自有或承租之**我國境內**生產場所或營業處所
2. 安裝地點於購置之次日起**3年**內如有變動，公司應自行向稅捐稽徵機關申請備查



五、先進製程設備適用範疇及抵減規定(2/2) 第10-12條

抵減方式

1. 購置設備支出金額**5%**，抵減當年度應納營所稅額，抵減上限為**30%**
 2. 設備支出金額不含政府補助款，以國稅局核定數為準 (§10)
- 當年度應納營所稅額包含營所稅及未分配盈餘稅 (§11)
 - 合併適用2項以上投資抵減，抵減上限為**50%** (§12)

適用年度基準

以機器或設備**完成交貨之年度**為適用年度 (§10)

支出範圍

1. 向他人購買：取得之**價款、運費及保險費**
2. 融資租賃取得：認列資產之金額屬**價款、運費、保險費**
3. 自行製造：生產機器或設備所發生之**實際成本**
4. 委由他人製造：生產機器或設備實際支付之**價款、運費、保險費**及自行負擔之部分**生產成本** (§10)

六、申請程序及申辦期間第13-14條、第17條

申請 投資抵減

1. 於當年度營所稅結算申報期間開始前3個月起至申報期間截止日內，向**中央目的事業主管機關**提出申請 (§13)
2. 逾期申請者，中央目的事業主管機關不予受理 (§13、§14)

以會計年度為曆年制申報為例：
公司須於**2月1日至5月31日**止，
完成投資抵減申請作業



營所稅 結算申報

1. 辦理當年度營所稅結算申報時，依財政部規定格式填報，送請**所在地稅捐稽徵機關**核定投資抵減稅額 (§17)
2. 若於當年度結算申報期間屆滿前未依規定格式申報者，**逾期不得適用**投資抵減 (§17)

以會計年度為曆年制申報為例：
公司須於**5月1日至5月31日**止，
辦理營所稅結算申報租稅減免

七、申請項目(1/5) 第13、14條

1

資格條件

- ✓ 國際供應鏈關鍵地位(\$2)
- ✓ 研究發展費用、有效稅率、設備支出金額(\$3)



- **1**為必要符合之資格條件。
- **2、3**則依公司投資項目，與**1**併案提出申請。

前瞻創新研發

- ✓ 前瞻創新研發活動
投入國際領先技術或成熟製造技術之創新研發(\$2)
- ✓ 須經核准的支出項目
與前瞻創新研發活動具關連性、合理性、必要性(\$5)

2

先進製程設備

- ✓ 自行使用於先進製程全新設備
投入開發國際領先技術進行商業化量產，或發展已達商業化量產之成熟製造技術之創新性應用 (\$2)

3

七、申請應備文件 (2/5)-資格條件第13條

1

居國際供應鏈關鍵地位說明

- 具體說明公司生產之產品或提供之服務在國際市場之影響力。
- 檢附具公信力之佐證資訊，如國際市場占有率、排名、進出口貿易等。
- 提出公司善盡社會責任，包含節能減碳措施之相關資料。

2

當年度個體財務報告

- 當年度研發費用達60億元及研發密度達6%之佐證資料。
- 依證券發行人財務報告編製準則(採國際財務報導準則版本)編制，並經會計師查核簽證。

3

當年度營所稅結算申報書之 損益與稅額計算表

- 當年度有效稅率未低於規定之12%或15%之佐證資料。
- 以營利事業所得稅結算申報書損益及稅額計算表所載金額核算有效稅率，填報於申請書欄位。

4

先進製程設備投資計畫書

- 申請先進製程設備投資抵減時檢附。
- 說明投資目的、購置項目說明及投資效益等。
- 當年度購置項目金額需達100億元。

七、申請應備文件(3/5) - 前瞻創新研發第13條

前瞻創新研究發展活動

1. 組織系統圖及**研究人員名冊**
2. 消耗性器材、原料、材料及樣品之完整**進、領料紀錄**
3. 專利權、專用技術、著作權、資料庫、軟體程式、系統之**契約或證明文件**
4. **研究計畫**
5. **教育訓練**項目明細表、參訓人員名冊及執行情形之相關文件
6. 其他有關證明文件

須經核准的支出項目

1. **專用技術**、專業性或特殊性**資料庫**、**軟體程式及系統**：**契約文件**或相關證明文件及**付款證明文件**
2. **委託國外學研機構**，或**聘請國外學研機構專任教師或研究人員**：委託或聘請之計畫及契約文件
3. 與國內外公司、學研機構**共同研發**：
 - (1)分攤之研究發展支出**符合**本辦法有關**前瞻創新研究發展**規定之相關說明
 - (2)支出分攤方式、投入內容及研發成果歸屬方式之**共同研發合約**
 - (3)**分攤**之支出與投入內容及**研發成果歸屬**約定顯著相當之證明文件
 - (4)與國外公司、學研機構共同研發，就其在**國內並無適當共同研發對象**之說明

七、申請應備文件(4/5) - 先進製程設備第14條



七、申請應備文件(5/5) – 表單下載路徑

(網址：https://www.ida.gov.tw)



經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

搜尋:

搜尋 進階搜尋說明

熱門關鍵字: 離岸風電 淨零碳排 半導體

最新消息

訊息公告

業務服務

申請事項

產業輔導

資訊專區

關於本署

› 案件進度查詢

› 申請事項及表單

產業創新條例相關申請事項

中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法(依中小企業發展條例第25條第3項規定訂定之)

0067 公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法(依產業創新條例第10條之2第6項規定訂定)

申請說明

▪ 懶人包 下載檔案(pdf)

法令/稅則

▪ 公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法總說明及逐條說明 下載檔案(pdf) (2023/10/02新增)

▪ 公告前瞻創新適用領域 下載檔案(pdf) (2023/10/02新增)

書表文件

八、審查機制第15-16條

§15

審查小組

中央目的事業主管機關指派召集人

設置審查委員11人以上

專家學者
(超過半數)

經濟部、
財政部、
國發會、
國科會等
代表



§16

審查流程

- 中央目的事業主管機關應於營所稅結算申報截止日後**7個月內**，將審查結果及意見函送公司與國稅局（以曆年制為例，應於**12月31日**止完成審查）
- 申請文件欠缺，屆期未補正或補正未完全，以現有申請資料逕予審查

九、變更適用規定(1/3) 第19-20條



為鼓勵公司加大投資，若「**資格要件**^(註)」經審查不符
可變更適用產創條例§10研發投資抵減、§10-1智慧機械投資抵減

公司申請變更適用三步驟 (§19)

- 1** 申請投資抵減：**聲明同意**變更適用
- 2** 營所稅結算申報時：**聲明同意**變更適用
- 3** 接獲資格條件審查不符通知之次日起**1個月內**：向稅捐稽徵機關**更正原營所稅**結算申報資料並**繳納稅款差額**

變更適用審查 (§20)

公司無須再提送申請書，審查機關將以公司原申請文件依產創條例§ 10、§ 10-1規定辦理審查

註：資格條件指①居國際供應鏈關鍵地位、②研發費用、③研發密度、④有效稅率、⑤設備金額任一項

九、變更適用規定 (2/3) – 申請書

○○○年度製造業及其相關技術服務業適用產業創新條例第10條之2投資抵減申請書

(本申請書一經塗改即失效)

公司申請日期	年 月 日
公司申請字號	

經濟部產業發展署台經：○

1. 依「公司前增創新研發及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」(以下簡稱本辦法)第13條第1項申請者，應符合第3條第1項或第2項資格條件規定。
2. 依本辦法第13條第2項第1款申請者，應提供公司前年度研究發展活動屬前增創新研發活動及符合第4條規定之審查意見。
3. 依本辦法第13條第2項第2款申請者，應檢附下列事項：
 第5條第1項第1款第3目專用技術
 第5條第1項第1款第4目專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統
 第5條第1項第2款第2目委託國外大專院校或研究機構研究，或聘請國外大專院校專任教師或研究機構研究人員
 第5條第1項第3款與國內外公司、大專院校或研究機構共同研究發展
4. 依本辦法第14條第1項申請者，應提供公司投資支出項目屬自行使用於先進製程之全新機器設備。

紅色框欄位請申請公司務必勾選同意或不同意，並應與營所稅結算申報聲明一致

(二) 申請人

公司名稱	營業登記統一編號
公司地址	
公司代表人	行業名稱及代號 (請依中華民國稅務行政機關分類表填寫)
公司聯絡人	電話 E-mail 傳真
公司會計年度	<input type="checkbox"/> 原半制 <input type="checkbox"/> 非原半制；會計期間○月○日~○月○日
申請適用年度營業收入淨額 (請檢附件附報表)	申請適用年度有效稅率 %
申請適用年度研究發展費用 (請檢附件附報表)	申請適用年度購置自行使用於先進製程之全新機器設備支出總金額
申請適用年度研究發展費用占營業收入淨額之比率 (請檢附件附報表)	(勾選申請事項4者填寫)
公司所在地稅捐稽徵機關	<input type="checkbox"/> 財政部臺北國稅局 <input type="checkbox"/> 財政部高雄國稅局 <input type="checkbox"/> 財政部北區國稅局 <input type="checkbox"/> 財政部中區國稅局 <input type="checkbox"/> 財政部南區國稅局

公司所在地稅捐稽徵機關

財政部臺北國稅局 財政部高雄國稅局
 財政部北區國稅局 財政部中區國稅局 財政部南區國稅局

(三) 同意 不同意 本公司上開申請事項如經貴署審查或所在地稅捐稽徵機關核定當年度不符本辦法第3條第1項或第2項資格條件規定，將變更適用產業創新條例第10條或第10條之1規定。
 (本欄請務必勾選，並應與公司當年度營利事業所得稅結算申報文件之聲明一致)

(三) 同意 不同意 本公司上開申請事項如經貴署審查或所在地稅捐稽徵機關核定當年度不符本辦法第3條第1項或第2項資格條件規定，將變更適用產業創新條例第10條或第10條之1規定。
 (本欄請務必勾選，並應與公司當年度營利事業所得稅結算申報文件之聲明一致)

(四) 申請須知：

1. 公司應於辦理當年度營利事業所得稅結算申報期間開始前3個月起至申報期間截止日內(原半制為2至5月)，依申請事項檢附申請書及相關文件，一併逕寄本署申請。逾期申請者，不予受理。

2. 申請日之認定，以申請書送達本署之日為準；但以掛號郵寄方式提出者，以空郵單之郵戳所載日期為準。

3. 公司申請檢附之各文件，若涉及機密性，請公司於申請書中自行妥為處理。

4. 申請檢附之文件將逕寄本署，不予發還。

5. 依本辦法第13條規定，申請公司就產業創新條例第10條之2第1項規定或其他為鼓勵研發之目的稅額所得稅優惠應申請適用；就產業創新條例第10條之2第2項規定或其他機器設備投資之所得稅優惠應申請適用。

6. 公司於聲明事項勾選同意，且後續經本署審查或所在地稅捐稽徵機關核定當年度不符本辦法第3條第1項或第2項資格條件規定者，請依本辦法第19條第3項規定辦理。

7. 不同公司申請案，應分別於不同信封袋(包裝)，分別郵寄、投遞，不可合併。

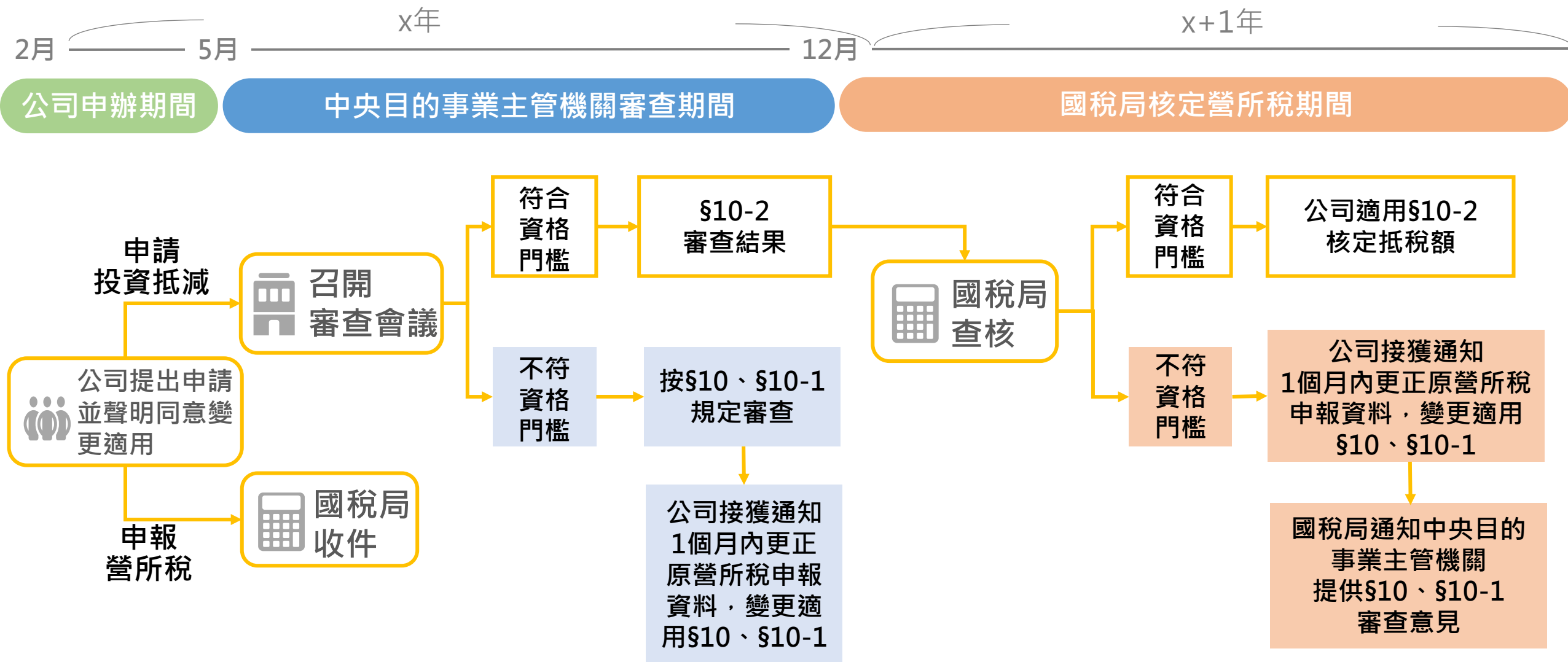
經濟部產業發展署 日期
 產業發展署 收文字號

(四) 申請須知：

1. 公司應於辦理當年度營利事業所得稅結算申報期間開始前3個月起至申報期間截止日內(原半制為2至5月)，依申請事項檢附申請書及相關文件，一併逕寄本署申請。逾期申請者，不予受理。

2. 申請日之認定，以申請書送達本署之日為準；但以掛號郵寄方式提出者，以空郵單之郵戳所載日期為準。

九、變更適用規定(3/3) - 流程圖



十、限制規定及適用期間第18條、第21-23條

§18 擇一申請適用

當年度
研究發展支出
僅能**擇一**
申請適用



產創條例第10條之2



研發租稅優惠
(如產創第10條)

當年度全部
購置設備支出
僅能**擇一**
申請適用



產創條例第10條之2



設備租稅優惠
(如產創第10條之1)

§21 變更限制

供前瞻創新研發之專利、資料庫等，以及先進製程之機器設備，**購置之次日起3年內**變更原使用目的，須補繳稅款加計利息

§22 虛報處罰

經國稅局查明有虛報情事者，依所得稅法逃漏稅處罰，並停止享受租稅優惠待遇

§23 適用期間

自112年1月1日起至118年12月31日止

十一、案例計算(1/2)

A公司申請112年度投資抵減如下：

1. 申請前瞻創新研發支出80億元、先進製程設備支出200億元，且已聲明同意變更適用規定。
2. 112年度營收淨額2,000億元、研發費用160億元、研發密度為8%(=研發費用160億元/2,000億元)、有效稅率13%。
3. 當年度應納營所稅額為100億元，抵減上限為100億元x上限比率30%=30億元，若合併2項投資抵減，抵減上限為100億元x上限比率50%=50億元。

情境1：A公司112年度符合產創條例第10條之2全部資格條件

經審查其前瞻創新研發適用支出金額為80億元、先進製程設備適用支出金額為200億元。

A公司可享有抵減稅額30億元，計算如下：

1. 前瞻創新研發支出80億元×抵減率25%=20億元，未超過抵減上限。
2. 先進製程設備支出200億元×抵減率5%=10億元，未超過抵減上限。
3. 兩項合計為20億+10億=30億元，未超過抵減上限。

十一、案例計算(2/2)

情境2：A公司112年度符合產創條例第10條之2共同資格條件、但設備金額未達門檻

經審查其前瞻創新研發適用支出金額為80億元，但先進製程設備適用支出僅90億元，未達門檻。由於A公司已依規定申請變更適用，因此設備部分依智慧機械規定進行審查，適用之設備支出金額為10億元(產創條例第10條之1適用上限為10億元)。

A公司可享有抵減稅額20.5億元，計算如下：

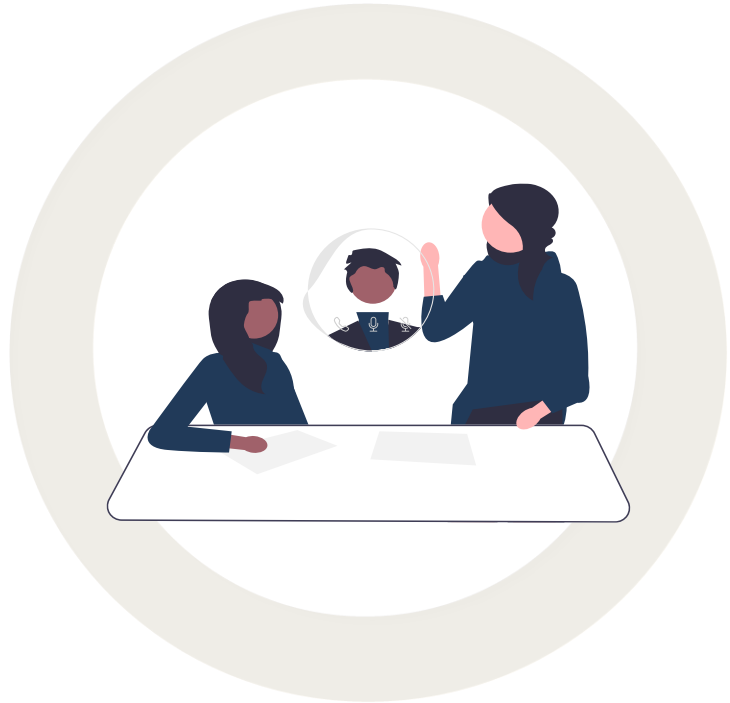
1. 前瞻創新研發支出80億元×抵減率25% = 20億元，未超過抵減上限。
2. 智慧機械設備支出10億元×抵減率5% = 0.5億元，未超過抵減上限。
3. 兩項合計為20億 + 0.5億 = 20.5億元，未超過抵減上限。

貳、 常見問題

NO.	問題	回應
1	<p>【擇一申請適用】</p> <p>A公司當年度研發投入200億元，符合前瞻創新研發為150億元，A公司能否就150億元申請產創條例第10-2條、其餘50億元申請第10條研發投抵？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A公司無法同時申請產創條例第10-2條及第10條。 2. 子法第18條規定，公司僅得就當年度全部的研發支出，就第10-2條及其他獎勵研發之租稅優惠，擇一申請適用，因此A公司倘擇定第10-2條申請金額為150億元，其餘50億元就無法再申請第10條。
2	<p>【變更適用的支出金額】</p> <p>A公司當年度研發投入200億元，符合前瞻創新研發為150億元，申請第10-2條，且依規定聲明同意變更適用；但資格條件經審查不符A公司能否將全數研發投入200億元變更適用第10條研發投抵？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A公司無法就未申請的研發金額變更適用。 2. 子法第19條變更適用規定已於說明欄位第一項後段明定，變更適用之支出金額，以不逾原申請支出金額為限，因此A公司僅能就原申請150億元變更適用第10條。
3	<p>【變更適用的投資範疇】</p> <p>B公司當年度申請第10-2條先進製程設備投資抵減，且依規定聲明同意變更適用；但因資格條件審查不符，變更適用成第10-1條智慧機械投資抵減，B公司是否能將當年度購置5G及資安設備納入變更適用？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. B公司無法將5G及資安設備納入變更適用。 2. 子法第19條、第20條已明定變更適用案件以不逾原申請支出金額為限且以公司原申請文件進行審查，因此B公司無法另將5G及資安設備納入變更適用。 3. 另須注意，第10-1條有適用上限10億元之規定，因此B公司變更適用時，適用支出金額最高為10億元。

NO.	問題	回應
4	<p>【變更適用的認定時點】</p> <p>子法第19條第2項規定，公司資格條件經審查或核定不符時將變更適用，請問經審查或核定不符的認定時點是指訴願或行政訴訟程序結束嗎？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不是。訴願或行政訴訟程序往往費時冗長，增加許多不確定性，為顧及申請人權利及政府機關行政效率，不以此做為認定的時點。 2. 依子法第19條第3項規定，認定時點如下： <ol style="list-style-type: none"> 1) 公司於接獲中央目的事業主管機關依子法第16條規定函發審查結果通知函或撤銷審查結果通知函； 2) 或是接獲稅捐稽徵機關函發之核定通知書，即為啟動變更適用之時點。 3. 提醒公司須於接獲上述通知書之次日起1個月內，更正原申報資料並繳納稅款，才算完備整個變更適用程序。
5	<p>【變更適用的行政救濟】</p> <p>公司已依子法第19條規定聲明同意變更適用，還能針對資格不符之行政處分提起訴願嗎？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可以。 2. 公司無論是否聲明同意，均不會影響其依訴願法提起訴願之權利。公司倘不符資格條件之審查結果，可於行政處分送達之次日起30天內提起訴願。

NO.	問題	回應
6	<p>【變更適用的條件】</p> <p>公司申請產創條例第10-2條，經國稅局核定前瞻研發的抵減稅額太低，公司是否可主張抵減金額過低，而申請變更適用第10條研發投抵？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司無法以抵減稅額過低之理由主張變更適用。 2. 子法第19條已明定僅有資格條件經審查不符，才能變更適用產創條例第10條或第10條之1，除此之外均無變更之適用。
7	<p>【境外研發的適用】</p> <p>若於境外進行技術研發，可以申請適用投資抵減嗎？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子法第7條明定，前瞻創新研發支出以在臺灣境內從事者才能認列。 2. 例外情形為依子法第5條規定，部分委外研發或共同研發須在國外執行之必要，且經中央目的事業主管機關審查核准，才能適用投資抵減。 3. 產創條例提供租稅誘因鼓勵產業在臺投資，並在臺擴散應用，始符合政府提供租稅獎勵之政策目的，因此除了上述委外或共同研發經審查核准之外，公司於境外從事研發活動，均無法申請適用投資抵減。



THANK YOU